

研究タイトル：

ナノ界面・ナノ空間における特異物性の解明と応用



氏名： 上條 利夫 / KAMIJO Toshio E-mail: kamijo@tsuruoka-nct.ac.jp

職名： 教授 学位： 博士(理学)

所属学会・協会： 日本分析化学会, 日本化学会, 日本トライボロジー学会, 日本表面科学会, 日本 MRS

キーワード： ナノ空間(ナノポーラス), 物質分離, シリカメソ細孔, 物性評価, トライボロジー

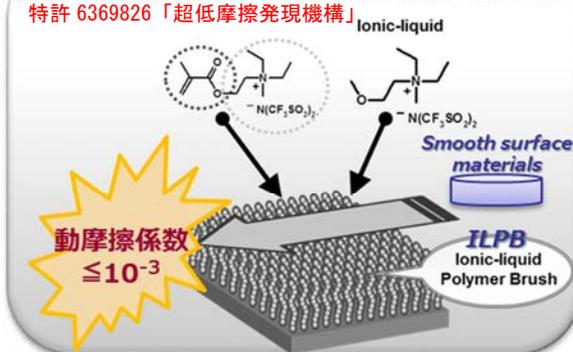
技術相談
提供可能技術：
 ・研究開発, 商品開発, に関する有効な進め方, データ取得のアドバイス
 ・各種機器分析(材料表面の粗さ, 形状測定, 摩擦・摩耗試験)による原因解明と応用
 ・各種研究機関との連携の相談

研究内容： イオン液体を用いた新規機能性材料の開発と評価

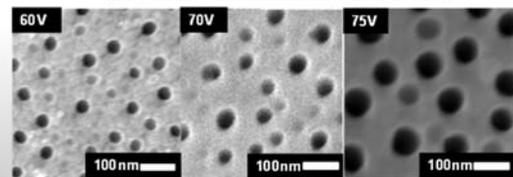
★イオン液体を用いた低摩擦摺動材料の開発

イオン液体濃厚ポリマーブラシ (ILPB) / 平滑摺動面

特許 6369826 「超低摩擦発現機構」



陽極酸化ポーラスアルミナ (PAA)



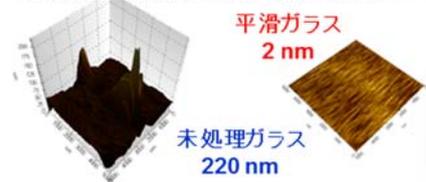
ILPBの基盤にPAAを利用することで, 低荷重下での利用や更なる低摩擦摺動システムへ期待

★所有分析装置で出来ること

原子間力顕微鏡
5100 AFM/SPM



表面形状, 表面粗さ情報を簡単に取得可能
表面の相互作用測定や液中測定にも対応



各種測定摺動面を設定した自動プログラムにより摩擦, 摩耗, 潤滑特性を取得可能
アタッチメントを多数所持しており, 様々な条件にて測定可能

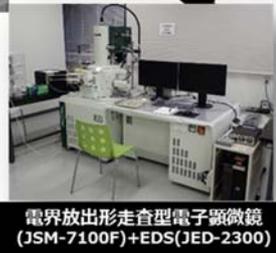


多検体比表面積/細孔分布測定装置 3FLEX



マイクロポア細孔分布測定から, 蒸気吸着による細孔表面の親・疎水性の評価までをこの1台で, 3サンプル同時測定可能

電界放出形走査型電子顕微鏡に反射電子検出器, エネルギー分散形X線分析装置を追加で取り付けた装置
数nmサイズの分解能の画像とともに組成情報(元素分析)を取得可能
だれでも簡単に使用できる設定



提供可能な設備・機器：

名称・型番(メーカー)	
紫外可視分光光度計 UV1800 (SHIMADZU)	真空蒸着装置 VTS-350M/ERH (ULVAC)
走査型電子顕微鏡 JSM-6390 (JEOL)	デジタルマイクロスコープ KH-1300 (Hirox)
原子間力顕微鏡 Agilent Technologies Series 5100 AFM/SPM	多検体比表面積/細孔分布測定装置 3FLEX (Micrometrics)
原子間力顕微鏡 AFM5200S (Hitachi)	ソフトプラズマエッチング装置 SEDE-GE (Meiwafosis)
表面性測定機 TYPE: 14FW, 38FW (HEIDON)	電界放出形走査型電子顕微鏡(JSM-7100F)+EDS(JED-2300)